

## MIPOS 600 OEM

### *Positionier- und Feinfokussierung für Objektive*

#### **Konzept:**

Die Systeme MIPOS 600 OEM bieten einen Positionier- und Scanbereich von bis zu 600 µm im unregelmäßigen und 500 µm im geregelten Betrieb. Sie können mit Objektiven von bis zu 40mm Durchmesser eingesetzt werden.

Das bewährte Parallelogrammprinzip von **piezosystem jena** garantiert eine hochparallele Bewegung ohne Beeinflussung der optischen Achse.

Um eine Position wiederholt und stabil ansteuern zu können, ist die Serie MIPOS SG 600 OEM mit einem integrierten Messsystem ausgerüstet. Das Design mit integrierter Vorspannung des Aktors bietet folgende Vorteile:

- hohe Resonanzfrequenz
- hochparallele Bewegung
- „upside-down“ Version für inverse Mikroskope.

Basierend auf diesen Eigenschaften können schnelle Scan-Applikationen mit geringsten Anstiegszeiten exakt realisiert werden.

#### **Besonderheiten:**

Separate Klemmringe für den Objektivrevolver ermöglichen eine schnelle Montage und Wechsel der MIPOS am Mikroskop. Andere Objektive müssen dabei nicht entfernt werden. Die für alle Standardmikroskopgewinde erhältlichen Einschraubringe machen die MIPOS 600 OEM universell einsetzbar.

Um die Parfokalität mit weiteren Objektiven zu gewährleisten, sind die entsprechenden Tubusverlängerungen als Zubehör verfügbar.

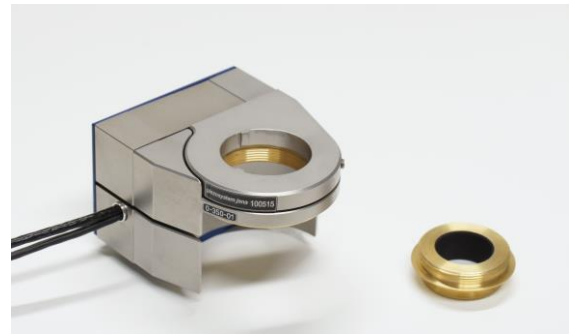


Bild: MIPOS 600 OEM

#### *Produkteigenschaften:*

- 600/500 µm Fokussierbereich (ol/cl)
- kompaktes Design
- hohe Resonanzfrequenz
- einfache Montage mittels Flexadapter
- universeller Einsatz durch Gewindeadapter
- optional integriertes Messsystem

#### *Anwendungen:*

- Oberflächen-Scannen und -Analyse
- Halbleiterequipment
- Scan-Interferometrie
- Biotechnologie  
(z.B. Zelluntersuchungen)
- Strahlfokussierung in Printprozessen

## MIPOS 600 OEM

### Technische Daten:

Artikelnummer		O-380-01D	O-387-00
Achse	-	z	z
Hub unregelt ( $\pm 10\%$ )*	$\mu\text{m}$	600	600
Hub geregelt ( $\pm 0,2\%$ )*	$\mu\text{m}$	500	-
Kapazität ( $\pm 20\%$ )**	$\mu\text{F}$	21.0	21.0
Integriertes Messsystem	-	DMS	-
Auflösung unregelt***	nm	0.9	0.9
Auflösung geregelt***	nm	12	-
typ. Wiederholbarkeit	nm	13	-
Resonanzfrequenz	Hz	190	190
zusätzl. Masse = 40g	Hz	161	161
zusätzl. Masse = 100g	Hz	134	134
zusätzl. Masse = 160g	Hz	118	118
Steifigkeit	N/ $\mu\text{m}$	0.144	0.144
Verkippung (Vollhub)	$\mu\text{rad}$	<20	<20
Spannungsbereich	V	-20 ... +130	-20 ... +130
Stecker****	Spannung	-	Lemo OS.302
	Sensor	-	-
Kabellänge	m	2	2
Material	-	Edelstahl	Edelstahl
Abmessung (L x B x H)	mm	60,5x50x40.1	60,5x50x40.1
Gewicht	g	370	370
max. Objektivdurchmesser	mm	40	40
max. Objektivgewicht	g	500	500
einsetzbar in Standardmikroskopen	-	Ja	Ja
einsetzbar in inversen Mikroskopen	-	Ja	Ja

\* typischer Wert gemessen mit EVD125 Verstärker

\*\* typisches Kleinsignalverhalten

\*\*\* Die Auflösung des Systems wird nur vom Rauschen des Verstärkers und der Messtechnik begrenzt.

\*\*\*\* In Kombination mit digitalen Steuereinheiten wird ein Sub-D 15 Stecker verwendet.

Die Artikelnummer wird mit Suffix „D“ erweitert.

## MIPOS 600 SG OEM

### Empfohlene Konfigurationen:

Aktor	<b>MIPOS 600 SG OEM</b>
Verstärker/Steuerung	<b>24DV40</b>
	<b>d-Drive mit EDV125</b>
	<b>30DV50</b>
	<b>30DV300</b>
	<b>NV120/1CLE</b>

*Die Serie MIPOS beinhaltet eine große Auswahl an Mikroskopobjektivpositioniersystemen mit einem Stellbereich von 20 µm bis zu 600 µm.*

*Mehr dazu finden Sie in der Rubrik „Objektivpositionierer“ unter [www.piezosystem.de](http://www.piezosystem.de)*

*Änderungen von technischen Daten und Konstruktionen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.*